

高速信号伝送用 LTCC インターポーザ

LTCC Interposer for High Speed Transmission

LSB Series

IoT (Internet of Things)の普及により、大量に生成されるデータをリアルタイム処理する必要性が高まっている。

システムの処理能力を大幅に高める方法として、シリコンインターポーザ上にLSI (Large Scale Integrated circuit) と広帯域メモリを近接配置し、1,000本/mm以上の高密度配線で結ぶ実装方式が注目されている。

しかし、シリコンインターポーザ は伝送損失が大きく、また有機基板 を併用するため、実装回数が多くな り、普及の妨げとなっていた(表1)。

これらの課題を解決するため、日 立金属は日立製作所と共同でLTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) インターポーザを開発した(**表 1**, **図 1**)。高周波部品実装用インターポーザとして当社での量産実績が豊富なLTCC 基板をベースに、新たに独自開発した技術を組み合わせ、シンプルで低コストな構造と、良好な伝送特性の両立を実現した(**図 2**, **図 3**)。

今回開発したLTCCインターポーザの最大の特長は、フォトリソグラフィ技術を適用してLTCC基板上に幅2 μ mの微細配線を形成したことにある($\mathbf{図1}$)。これを可能にするために、以下の技術を新たに開発した。

・LTCC基板の歪みを低減する高

精度 LTCC 焼成技術 (寸法精度 ± 0.05%)

- LTCC 基板の反りや凹凸を低減 する精密研磨技術(平坦度 < 2 μm, 面粗さ < 2 nm)
- ・LTCC 基板上に幅 2 μ m の多層 配線を形成する技術 (**図 2**)

今後、FPGA(Field Programmable Gate Array)や GPU(Graphic Processing Unit)などの高速信号処理分野への拡販と併せ、本技術をMEMS (Micro Mechanical Electrical Systems)センサー用途のほか、広範囲な用途への応用を進めていく。

(磁性材料カンパニー)

25 μm dia. Cu via pad

表 1 LTCC インターポーザとシリコンインターポーザの比較 Table 1 Comparison of LTCC and silicon interposers

	Units	LTCC interposer	Silicon interposer
Structure	_	Fine line layer Memory LSI	Silicon interposer Fine line layer Memory LSI Organic sub.
Substrate Line/space	μm	2/2 (Fine line layer)	2/2 (Fine line layer)
		30/30 (LTCC sub.)	30/30 (Organic sub.)
Stacking levels	_	1	2
Channel loss (12.5 GHz)	dB/cm	0.93	1.55

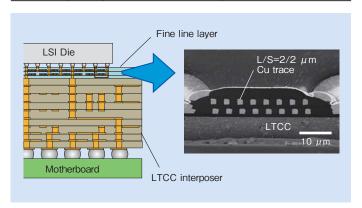


図 2 LTCC インターポーザの概念図と微細配線層の断面 Fig. 2 Schematic of LTCC interposer and cross-sectional SEM image of fine line layer

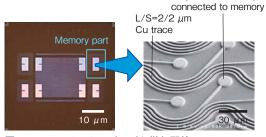


図1 LTCC インターポーザと微細配線

Fig. 1 Appearance of LTCC interposer and fine lines

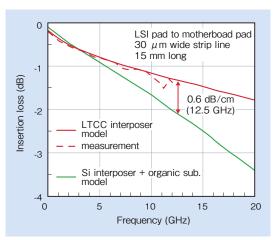


図3 LTCC インターポーザとシリコンインターポーザ の電気的特性

Fig. 3 Electrical performance of LTCC and silicon interposers